# DBD および VUV による励起アンモニアの組成

神原 信志 小貝 美江\* (岐阜大学)

増井 芽 (アクトリー) 菱沼 宣是 (ウシオ電機) 守富 寛 (岐阜大学)

#### Composition of activated ammonia by DBD or VUV

Shinji KAMBARA, Mie KOKAI\* (Gifu University) Megumi MASUI (ACTREE Corporation), Nobuyuki HISHINUMA (USHIO Inc.) Hiroshi MORITOMI (Gifu University)

Advanced selective non-catalytic reduction system (SNCR) by activated ammonia injection using a vacuum ultra violet (VUV) or a dielectric barrier discharge (DBD) have been developed for flue gas clean-up from combustors. In this paper, chemical compositions of the activated ammonia at DBD reactor exit and VUV reactor exit were investigated to elucidate NOx reduction mechanisms. Molecular ammonia diluted with argon was employed as deNOx agent. An increace of applied voltage in the DBD reactor caused increases of the decomposition of molecular ammonia. Molecular hydrogen and nitrogen were measured at the DBD reactor. The same behaviors were observed in the VUV reactor.

**キーワード**: DBD, VUV, アンモニア, 励起 (Keywords: DBD, VUV, Ammonia, Activation)

# 1. 緒言

我々はこれまでラジカル連鎖反応を利用したラジカルインジ エクション脱硝法の開発をおこなってきた<sup>(1)-(5)</sup>。ラジカルイ ンジェクション法とは、NH3を大気圧プラズマ(誘電体バリ ア放電:DBD)で励起し、それを燃焼排ガスに吹き込むこと により、反応場で NO 除去に有効なラジカルを生成させ、高 効率脱硝を行うものである。本法は、脱硝剤のみを励起する ため、電力消費量が極めて少なくなることに加え、装置が小 型で単純なこと、冷却水を必要としないことなどの利点を有 する。

ラジカルインジェクション法では、 $600^{\circ}$ C 以上で脱硝反応 が開始し、温度が高いほど低電圧で高脱硝率が得られる特性 を示す。これは、DBD に NH<sub>3</sub>を通過させると、NH、NH<sub>2</sub>、N といった活性化学種以外にも N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>H<sub>4</sub> といった安定化学 種が生成し、それらが温度場で NH<sub>i</sub> ラジカルを生成し、脱硝 反応に寄与すると考えている。

 一方, DBD 以外の方法により NH<sub>3</sub>を励起する方法として, 波長 172 nm の真空紫外光 (VUV) を照射する方法を最近見 いだした<sup>(6)</sup>。NH<sub>3</sub> ガスの光吸収係数は, Fig.1 に示すように 172 nm で 85 atm<sup>-1</sup>cm<sup>-1</sup>あり, NH<sub>3</sub>分子はこの波長により 励起され, NH や NH<sub>2</sub> といった活性化学種を生成すると考え られる。この方法によるラジカルインジェクション脱硝法 (VUV 脱硝法)においても,DBD 脱硝法とほぼ同等の脱硝 特性が得られた<sup>(6)</sup>。

本研究は、DBD 脱硝法と VUV 脱硝法の特性を比較するこ とで、アンモニアラジカルインジェクションにおける脱硝反 応機構を解明し、脱硝法の最適化を図ることを目的としてい る。その研究の第一段階として、本報では DBD 脱硝法と VUV 脱硝特性の比較、DBD/VUV リアクター出口のガス組 成の比較を行った。



# 2. 実験装置および実験方法

# 〈2.1〉 DBD 脱硝実験装置

Fig.2 に DBD 脱硝実験装置の概要を示す。装置は、アンモニ アガス (NH<sub>3</sub>/Ar) 供給部、DBD リアクター、高電圧パルス電源、 模擬排ガス (NO/O<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>) 供給部、模擬排ガス予熱部、脱硝反応 部、ガス分析装置から成っている。

DBD リアクターは石英製円筒二重管構造であり,外筒外径 61 mm,内筒外径 50 mm,長さ 490 mmの石英管であり,ギャ ップ長 1.5 mmである。澤藤電機製高電圧パルス電源を用いて, 誘電体バリア放電により大気圧プラズマを発生させた。高電圧 電極(SUS316)は内筒石英管に挿入し,接地電極(SUS316パ ンチングメタル)は外筒周囲に巻き付けた。接地電極の長さは 360 mmであり,プラズマはこの間で発生する。

実験では、DBD リアクターに Ar 希釈のアンモニアガスを流 した後、プラズマを点灯して励起アンモニアを生成し、それを 模擬排ガスに混合した。所定の NO 濃度に調整された模擬排ガ スは 500℃ に予熱されて、ミキシングチャンバーで励起アンモ ニアと混合される。その後、500-900℃ に設定された反応管内 で脱硝反応が起こる。



図2 脱硝実験装置の概要

Fig.2 Schematic diagrams of experimental apparatus.

# 〈2.2〉 VUV 脱硝実験装置

VUV 脱硝装置は, Fig.2 に示した装置構成と同じであり, DBD リアクターを Fig.3 に示す VUV リアクターに置き換え た構成とした。

VUV リアクターは、外径 40 mm、長さ 105 mm の Xe ガス 封入誘電体バリア放電方式のエキシマランプ(USHIO Inc.製) の周囲に、アルミ製円筒カバー(内径 80 mm)を配置し、ラ ンプ表面とカバー内面の間を窒素希釈のアンモニアガスが 流れるようにした。アンモニアガスは、円筒流路を下から上 に流れ,この間でガスに光が照射される。エキシマランプからは,波長172 nmのほぼ単一波長の真空紫外光が26 mW/cm<sup>2</sup>の出力で放射される。



Fig. 3 Configuration of the VUV reactor.

#### 〈2.3〉 DBD/VUV 出口ガス組成の測定

DBD または VUV リアクター出口のガス組成(NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>) をガスサンプラー付き高速ガスクロマトグラフ(Agilent 3000A Micro GC, 検出器 TCD)で分析した(Fig.2)。分析に 用いたキャピラリーカラムは,モレキュラーシーブ 5A(外 径 0.32 mm, 長さ 10 m, 膜厚 25 µm)であり,カラム温度を 100℃ としたとき,分析時間は 60 秒であった。

出口ガス組成の測定は、アンモニアガスの濃度や滞留時間の影響を調べるために、脱硝実験とは別のルーチンで行った。 Table 1 には DBD リアクターの、また Table 2 には VUV リア クター出口のガス組成測定実験の条件を示した。

表 1	<b>DBD</b> 出口の大	ブス組成測	定実験条	:件
Table 1 Exp	erimental conditi	ions of gas	analaysis	for DBD.

		Unit	1	2	3	4
Reactant gas	$\mathrm{NH}_3$ conc.	ppm	4900	4900	4900	4900
	$\mathrm{NH}_3$ flow rate	L/min	0.80	0.40	0.20	1.20
	Residence time	s	7.1	14.1	28.2	4.7

表 2	VUV 出口のガス組成測定実験条件	

Table 2 Experimental conditions of gas analaysis for VUV

		Unit	1	2	3	4
	$\mathrm{NH}_3$ conc.	ppm	4900	4900	4900	4900
Roactant gas	$\mathrm{NH}_3$ flow rate	L/min	0.31	0.46	0.31	0.46
neactant gas	Ar flow rate	L/min	-		1.19	1.04
	Residence time	s	73.0	49.2	15.1	15.1
Total flow gas	NH <sub>3</sub> conc.	ppm	4900	4900	1013	1503
Total now gas	Flow rate	L/min	0.31	0.46	1.50	1.50
		Unit	5	6	7	
Reactant gas	NH <sub>3</sub> conc.	ppm	4900	4900	4900	
	$\mathrm{NH}_3$ flow rate	L/min	0.62	1.03	1.86	
	Ar flow rate	L/min	0.88	0.47	0.84	
	Redidence time	s	15.1	15.1	8.4	
Total flow gas	NH <sub>3</sub> conc.	ppm	2025	3365	3376	
	Flow rate	L/min	1.50	1.50	2.70	

# 3. 実験結果

# 〈3.1〉 DBD 脱硝法と VUV 脱硝法の特性比較

Fig.4 に, 模擬排ガス流量 2.7 L/min, NH<sub>3</sub>/Ar 流量 0.3 L/min, NO 初期濃度 500 ppm, O<sub>2</sub>濃度 2.1%, NH<sub>3</sub>/NO モル比 1.5 の時の脱硝率の変化を反応温度に対して示した。脱硝率は, DBD 脱硝法, VUV 脱硝法, 熱的脱硝法(Thermal)について示してある。

熱的脱硝法では,800℃ 付近で急激に脱硝反応が開始する が、VUV 脱硝法では 600℃ 程度から脱硝が始まり、反応温 度の増加にともなって脱硝率は増加した。一方、DBD 脱硝 法では、600℃ですでに脱硝率 11%を示し、VUV よりも若干 ながら低温で脱硝率が高くなった。650℃ 以上では VUV 脱 硝法と DBD 脱硝法はほぼ同等の脱硝率を示した。

これより,DBD/VUV 脱硝法ともに,励起アンモニアが低 温での脱硝に大きく寄与していることがわかる。



図 4 DBD 法, VUV 法, Thermal 法による脱硝特性の比較 Fig.4 NO removal characteristics by DBD, VUV, and thermal deNOx as a function of temperature.

# 〈3.2〉 DBD リアクター出口ガス組成

Fig.5(a), (b), (c)は、印加電圧に対するアンモニア分解率(a), 水素転換率(b), 窒素転換率(c)の変化を NH<sub>3</sub>/Ar ガス流量をパ ラメータとして示した図である。分解率と転換率の計算は, 以下の総括反応を基準とした。

$$NH_3 + e \rightarrow 1.5H_2 + 0.5N_2 + e$$
 (1)

すなわち、 $NH_3$ 分解率 $D_{NH3}$  [%],  $H_2$ 転換率 $C_{H2}$ [%],  $N_2$ 転換率 $C_{N2}$  [%]は、次式で算出した。

$D_{\rm NH3} = ([\rm NH_3]_0 - [\rm NH_3]_1) / [\rm NH_3]_0 \times 100$	(2)
$C_{\rm H2} = [{\rm H_2}]/(1.5 \times [{\rm NH_3}]_0 \times D_{\rm NH3}) \times 100$	(3)
$C_{\rm N2} = [N_2]/(0.5 \times [NH_3]_0 \times D_{\rm NH3}) \times 100$	(4)

ここで, [NH<sub>3</sub>]<sub>0</sub>は DBD リアクター入口の NH<sub>3</sub>濃度[ppm],, [NH<sub>3</sub>]<sub>1</sub>は DBD リアクター出口の NH<sub>3</sub>濃度[ppm], [H<sub>2</sub>], [N<sub>2</sub>] はそれぞれ DBD リアクター出口の H<sub>2</sub> 濃度[ppm], N<sub>2</sub> 濃度 [ppm]である。

印加電圧の増加およびガス流量の減少にともなって NH<sub>3</sub> 分解率は増加した (Fig.5(a))。特に,ガス流量 0.2 L/min,  $V_{pp}$ = 15 kV において NH<sub>3</sub>は 100%分解された。これは,単位時 間,単位 NH<sub>3</sub> モルあたりに投入された電力(滞留エネルギ 一密度: W/mol-NH<sub>3</sub>'s)が増加するほど NH<sub>3</sub>分解率が高くなっ たものと説明できる。





一方, Fig.5(b)からわかるように,水素転換率(分解した NH<sub>3</sub>がH<sub>2</sub>に転換した割合)は80-90%の範囲にあり,分解し た NH<sub>3</sub>の大部分は水素に転換していることがわかった。これ は例えば(5)式の分解反応として考えられる。しかし、印加電 圧が高くなるほど水素転換率は低下する傾向が見られたこ とから、印加電圧が高くなると、例えば(6)式の分解反応が開 始し、(7)式で N<sub>2</sub>が生成するものと考えられる。

$NH_3 + e \rightarrow NH + H_2 + e$	(5)
$NH + e \rightarrow N + H + e$	(6)
$N + N \rightarrow N_2$	(7)

次に Fig.5(c)を考察する。窒素転換率は、ガス流量 0.4-0.8 L/min では印加電圧の増加とともに増加し、(6)、(7)式による 窒素の生成反応が起こったものと説明できるが、ガス流量 0.2 L/min ではその逆の挙動を示した。これについては、今後 さらに考察する予定である。

Fig.6 は、DBD リアクター出口の励起アンモニアを化学種 別の組成割合として、印加電圧ごとに示した図である(ガス 流量 0.8 L/min)。組成割合としてみると、印加電圧が高くな るほど  $H_2$  と  $N_2$ の割合が増加し、さらにわずかではあるが、 不明(Unknown)の生成物も存在すると推定された。





Fig.6 Chemical composition of excited ammonia at the DBD reactor exit.

## 〈3.3〉 VUV リアクター出口ガス組成

VUV リアクター内に  $NH_3$ を通過させると、以下の総括反応により  $H_2$ や  $N_2$ が生じると考えられる。

 $NH_3 + hv(172 \text{ nm}) \rightarrow 1.5H_2 + 0.5N_2$  (8)

DBD リアクターの場合,印加電圧,周波数,NH<sub>3</sub>ガス流量, NH<sub>3</sub> 濃度を変化させることによって滞留エネルギー密度を 変化させることができるが,VUV リアクター(Fig.3)の場 合はエキシマランプを1本しか持っていないため,NH<sub>3</sub>ガス 流量と NH<sub>3</sub> 濃度のみを変化させることによって滞留エネル ギー密度の変化が可能である。

**Fig.7**は、(NH<sub>3</sub>ガス濃度) × (NH<sub>3</sub>ガス滞留時間)を関数 に、VUV リアクター出口における水素濃度の変化を示した 図である。現在のところ、VUV 出口の NH<sub>3</sub>濃度の測定値が 不安定であるため,ここでは水素濃度として示す。この図より,NH<sub>3</sub>ガス流量が少なくNH<sub>3</sub>濃度が高いほど,すなわちアンモニアに寄与するフォトンエネルギーが高いほど,NH<sub>3</sub>は分解し,H2が生成するものと考えられる。



Fig.7 Hydrogen concentration at the VUV reactor exit.

# 4. 結言

DBD リアクター出口の励起アンモニアの化学組成は,主 に未反応アンモニア,分解生成物である水素・窒素であるこ とがわかった。NH<sub>3</sub>分解率,H<sub>2</sub>,転換率,N<sub>2</sub>転換率は,印加 電圧の影響を強くうけることがわかった。

VUVリアクター出口の励起アンモニアも同様にH2を生成 した。NH3ガス流量が少なく NH3濃度が高いほど、すなわ ちアンモニアに寄与するフォトンエネルギーが高いほど、 NH3は分解し、H2が生成するものと考えられる。

# 文 献

- K. Yukimura, K. Kawamura, T. Hiramatsu, H. Murakami, S. Kambara, H. Moritomi and T. Yamashita: *Thin Solid Film*, **515** (2007) 4278.
- (2) K. Yukimura, T. Hiramatsu, H. Murakami, S. Kambara, H. Moritomi, T. Yamashita, *IEEE Trans. of Plasma Sci.*, 34 (2006) 235.
- (3) K. Yukimura, K. Kawamura, S. Kambara, H. Moritomi, T. Yamashita: *IEEE Trans. of Plasma Sci.*, 33 (2006) 763.
- (4) S. Kambara, Y. Kumano, H. Moritomi, I. Nagao, K. Yamamoto, K. Yukimura, T. Maruyama; *Jpn. J. Appl. Phys.*, 44, Part I (2005) 1427.
- S. Kambara, Y. Kumano, K. Yukimura, *IEEE Trans. Dielect. Elect. Ins.*, 16 (2009),778.
- (6) 神原、近藤、早川、増井、菱沼、電気学会プラズマ研究会資料、PST-10 No.65-66.68-69.71-85 (2010), 29.